GAS SENSOR

Patent number:

JP10332585

Publication date:

1998-12-18

Inventor:

SOTANI TOSHIYUKI

Applicant:

HORIBA LTD

Classification:

- international:

G01N21/61; G01N21/03; G01N21/35

- european:

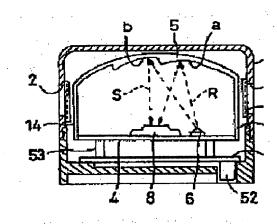
Application number: JP19970157719 19970529

Priority number(s):

Abstract of JP10332585

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a gas sensor which can be miniaturized and simplified by a method wherein infrared light radiated from a light source is reflected by a concave reflecting mirror and its reflected luminous flux is converged separately by two elements whose sensitivity wavelength is different.

SOLUTION: A circuit board 4 and a cancave reflecting mirror 5 are housed inside a metal case. In addition, a light source 6 and a photodetector are arranged on the circuit board 4. A filter holder 8 is arranged on the circuit board 4 in a state that it covers the photodetector. Two light-receiving parts whose sensitivity wavelength is different are built in the photodetector. That is to say, the light-receiving part on one side is constituted of a dual element which is provided with an electrode for temperature compensation and with a lightreceiving electrode for CO2, and the light-receiving part on the other side is constituted of a dual element which is provided with an electrode for temperature compensation and with a light-receiving electrode for comparison. A reflected luminous flux which is reflected by the reflectingmirror face (a) of the concave reflecting mirror 5 out of infrared light radiated from the light source 6 is converted on the light-receiving electrode for CO2, and a reflected luminous flux which is reflected by its reflecting-mirror face (b) is converged on the light-receiving electrode for comparison. Since an optical path R and an opticap path S are formed separately, the condensing efficiency of a gas sensor is good.



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-332585

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記 号	FI		
GO1N 21/61		GO1N 21/61		
21/03		21/03	Z	
21/35		21/35	Z	
		審査請求 未請求	* 請求項の数5 FI	(全7頁)

番目明小 小明小 明小天 の外 10 12 11 17 1

(21)出願番号

特願平9-157719

(22) 出願日

平成9年(1997)5月29日

(71)出願人 000155023

株式会社堀場製作所

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

(72)発明者 操谷 俊之

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

株式会社堀場製作所内

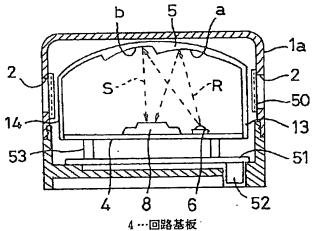
(74)代理人 弁理士 藤本 英夫

(54) 【発明の名称】 ガスセンサ

(57)【要約】

【課題】 小型化および簡素化を図ることができるガス センサを提供すること。

【解決手段】 凹面反射鏡5に対向させて光源6を設け、この光源6から出射された赤外光の反射光束が集束する位置またはその近傍に感度波長の異なる2つの受光部10,12が内蔵された単一の受光器7を設け、前記光源および受光器と前記凹面反射鏡との間の空間に被測定ガスを含むガスを流入させるよう構成したガスセンサにおいて、前記凹面反射鏡が、前記反射光束を前記一方の受光部10と前記他方の受光部12に個別に集束させるよう構成されている。



5…楕円反射鏡(凹面反射鏡)

6 …光源

a, b…楕円反射鏡の反射鏡面

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 凹面反射鏡に対向させて光源を設け、この光源から出射された赤外光の反射光束が集束する位置またはその近傍に感度波長の異なる2つの受光部が内蔵された単一の受光器を設け、前記光源および受光器と前記凹面反射鏡との間の空間に被測定ガスを含むガスを流入させるよう構成したガスセンサにおいて、前記凹面反射鏡が、前記反射光束を前記一方の受光部と前記他方の受光部に個別に集束させるよう構成されていることを特徴とするガスセンサ。

【請求項2】 前記凹面反射鏡が、前記反射光束を前記一方の受光部および前記他方の受光部に別々に集束させる異なる楕円形状の反射鏡面を有する請求項1に記載のガスセンサ。

【請求項3】 前記一方の受光部が温度補償用電極とCO,用受光電極を有するデュアル素子で構成され、前記他方の受光部が温度補償用電極と比較用受光電極を有するデュアル素子で構成され、前記受光器の前面には、CO,の特性吸収帯域の赤外光のみを通過させる光学フィルタを前記CO,用受光電極に対応させて設け、CO,による吸収のない帯域の波長の赤外光を通過させる光学フィルタを前記比較用受光電極に対応させて設け、前記反射光束を前記CO,用受光電極および前記比較用受光電極に別々に集束させてある請求項1または2に記載のガスセンサ。

【請求項4】 前記光源と受光器が前記凹面反射鏡に対向させる形で同一回路基板上に配置され、かつ、この回路基板上に前記各光学フィルタを保持するフィルタホルダが前記受光器を覆う状態で配置されている請求項1乃至3のいずれかに記載のガスセンサ。

【請求項5】 前記光源を電気的にオン・オフする直接 変調方式が採用されている請求項1乃至4のいずれかに 記載のガスセンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば室内の空調制御用ガスセンサやガス管理区域内に設置されるガス 警報機あるいはガス濃度測定器として使用される赤外線 吸収を利用したガスセンサに関する。

[0002]

【従来の技術】最近、「IAQ (=Indoor Air Qualit y)」が叫ばれ、小型かつ安価でメンテナンス性の優れたガスセンサが求められるようになってきた。このような要求に対して半導体やセラミックを用いた様々なガスセンサが開発されているが、例えばCO, センサについてはガス選択性、感度の経時安定性に課題が多く、感度・安定性共に優れた赤外線吸収を利用した、いわゆる、NDIR (非分散型赤外線ガス分析計: Non Dispersive Infrared Analyzer)が使用されている。

【0003】従来、測定範囲が2000ppm程度また 50

はそれ以下の比較的低濃度レンジで赤外線吸収を利用し たCO1 計として、図9に示すようなシングルセルタイ プの光チョッピング方式のものがある。図9において、 91は吸収セルで、両端に光源92と受光器93が配置 され、吸収セル91と受光器93間に光源92からの赤 外光をチョッピングする機械式の光チョッパ94を設 け、受光器93の前面に、CO。の特性吸収帯域の赤外 光のみを通過させる光学フィルタ〔例えば、中心透過波 長4. 3 μ m (波数が 2 3 0 0 c m⁻¹) のバンドパスフ ィルタ〕95とCO:による吸収のない帯域の波長の赤 外光を通過させる光学フィルタ〔例えば、中心透過波長 3. 7 μm (波数が 2 6 0 0 c m⁻¹) のバンドパスフィ ルタ〕96とを設け、受光器93から出力された検出信 号を演算処理することにより CO: ガスの濃度値を出力 する。なお、97は、被測定ガスであるCO,を含むガ スを吸収セル91内に導入するための吸引ポンプであ る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記構成の 比較的低濃度レンジのCO2 計を、室内の空調制御用ガスセンサやガス管理区域内に設置されるガス警報機あるいはガス濃度測定器として使用するためには、光学系ベンチの構造を小型化、かつ簡素化することが望まれるけれども、感度を上げるのに必要な吸収長(光路長)を確保した上での小型化には限界がある。すなわち、光源92と受光器93の開き角を大きくとれないため、感度を上げるには、吸収長をできるだけ長くするしかなく、前記吸収セル91としては例えば、数cm~十数cmのようなセル長Lの長いものが要求され、CO2 計全体の構 30 成が大型化する。

【0005】更に、光チョッパ94や吸引ポンプ97等の可動部を有するため、構造が複雑化し、その上、故障の原因ともなるため、定期的な保守・点検にも手間がかかる。また、光チョッパ94や吸引ポンプ97の作動音も静かな室内では気になるものであった。

【0006】この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、小型化および簡素化を図ることができるガスセンサを提供することにある。

[0007]

40

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明のガスセンサは、凹面反射鏡に対向させて光源を設け、この光源から出射された赤外光の反射光束が集束する位置またはその近傍に感度波長の異なる2つの受光部が内蔵された単一の受光器を設け、前記光源および受光器と前記凹面反射鏡との間の空間に被測定ガスを含むガスを流入させるよう構成したガスセンサにおいて、前記凹面反射鏡が、前記反射光束を前記一方の受光部と前記他方の受光部に個別に集束させるよう構成されている。

[0008]

10

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。図1~図3はこの発明のガスセンサの全体構造を示し、図4および図5は、それぞれ、受光器を収容しているフィルタホルグおよび受光器を示す。この実施形態では、ガスセンサとして測定範囲が2000pm程度またはそれ以下の比較的低濃度レンジのCO2 ガスセンサを採用している。

【0009】図1~図5において、1は、金属製の上部ケース1a, 金属製の下部ケース1bからなる1つの金属ケースである。

【0010】2は、上部ケース1aの4つの側面に設けられた正面視矩形の縦長の開口部で、この開口部2は各側面において横方向に複数個並置されており、被測定ガス(CO:)を含むガスはこれら開口部3より、自然拡散によりケース1内に流入する。

【0011】この金属ケース1内には、回路基板4と回路基板4に保持された楕円反射鏡(凹面反射鏡の一例) 5が収容されている。更に、前記回路基板4上には楕円 反射鏡5に対向させる形で光源6と受光器7が適宜間隔 を置いて配置されている。8はフィルタホルダで、前記 20 受光器7を覆う状態で回路基板4上に配置されている。 前記受光器7は、このフィルタホルダ8によって、光源 6からの熱の影響を受け難くなっている。

【0012】前記フィルタホルダ8は上方開口32を有し、この開口32を閉塞するように赤外遮光用の蓋33が取り付けられている。この蓋33には、2つの穴m、nが穿設され、穴mには、 CO_1 による吸収のない帯域の波長の赤外光を通過させる光学フィルタ [例えば、中心透過波長 3.7μ m(波数が2600cm⁻¹)のバンドパスフィルタ】30が設けられ、穴nには、 CO_1 0 30特性吸収帯域の赤外光のみを通過させる光学フィルタ [例えば、中心透過波長 4.3μ m(波数が2300c

m⁻¹)のバンドパスフィルタ〕31が設けられている。 【0013】前記光源6は例えばタングステンランプである。そして、電気的に光源6をオン・オフする直接変調方式を採用している。その点滅周期を、例えば2.8 秒に設定してある。図6にはその光源印加電圧と光源発光出力が示されている。

【0014】一方、前記受光器7には、感度波長の異なる2つの受光部が内蔵されている。すなわち、一方の受 40 光部が温度補償用電極9とCO2用(測定用)受光電極10を有するデュアル素子(焦電検出器やサーモパイル)Aで構成され、他方の受光部が温度補償用電極11と比較用受光電極12を有するデュアル素子(焦電検出器やサーモパイル)Bで構成されている。しかも、温度補償用電極9,11に赤外光が入射しないように遮光してある。

【0015】前記楕円反射鏡5は、光源6から出射された赤外光の反射光束をCO:用(測定用)受光電極10 に集束させる楕円形状の反射鏡面aと、光源6から出射 50

された赤外光の反射光束を比較用受光電極12に集束させる楕円形状の反射鏡面bとを有する。つまり、前記出射赤外光が楕円反射鏡5の前記反射鏡面aで一回折り返されて前記受光電極10に至る折り返し光路Rと、前記出射赤外光が楕円反射鏡5の前記反射鏡面bで一回折り返されて前記受光電極12に至る折り返し光路Sが別々に形成されている。

【0016】楕円反射鏡5の材質は、例えば鋳造用金属または射出成形用合成樹脂(ABSなど)であり、この実施形態では、楕円反射鏡5を射出成形で製作している。そして、反射鏡面a,bには、赤外域で高い反射率を示す金属(アルミニウム、モリブデンーマンガン、クロムなど)が蒸着、または、メッキされている。なお、楕円反射鏡5は、両端から垂下延設された保持部13,14を介して回路基板4上に保持されている。この実施形態では、前記保持部13,14は楕円反射鏡5と一体成形されている。

【0017】前記受光器7は、上述したように、二組の 電極9,10、11,12を有する二つのデュアル素子 A、B、すなわち、デュアルツインタイプに構成されて おり、前記受光器7は二つのデュアル素子A, Bを1つ のケース15に内蔵してなる。具体的に説明すると、前 記ケース15は鉄やニッケルあるいはコバールなど適宜 の金属よりなる下部開放型の円筒状ケースで、その上面 には開口16が形成され、この開口16を閉塞するよう に赤外線透過性の窓材17が取り付けられている。この 窓材17はサファイア、BaF.等の材料からなる。1 8はケース15の下部開口19を封鎖するステムであ る。20は、例えばセラミックよりなる回路基板で、そ の上面には例えばPZT(チタン酸ジルコン酸鉛系セラ ミックス) よりなる焦電部材21が適宜のスペーサ22 を介して保持されている。そして、焦電部材21の上下 両面に前記4つの各電極9~12が設けられている。こ れら各電極9~12は図7に示す等価回路のように接続 されている。

【0018】図7において、 V_{00} は電源端子で、Eはアース端子、 V_{51} および V_{51} は、それぞれ出力端子である。この出力波形は、図6に示されている。そして、前記電極10と9、12と11は、それらの電極(符号+, -で示す)が直列逆接続されている。

【0019】更に、図4、図5に示すように、窓材17には、温度補償用電極9,11に赤外光が入射しないように部分的に遮光部材23が設けられており、CO:用(測定用)受光電極10と比較用受光電極12のみが窓材17に臨み、この窓材17を経た赤外光がそれぞれ前記各電極10,12に入射し、温度補償用電極9,11には赤外光が入射しないように構成されている。つまり、温度補償用電極9,11は遮光状態となるように構成されている。24は光透過部である。なお、この実施形態では、CO:用(測定用)受光電極10と温度補償

用電極9、比較用受光電極12と温度補償用電極11 は、同一形状、同一受光面積を有し、対称(前記電極 9,10、前記電極11,12がそれぞれ線対称)にし かも近接した状態で、例えば「田」字状に配置されてい

【0020】そして、前記電極10と9、12と11 は、インピーダンス変換用のFET25、焦電流を電圧 に変換する時定数調整用の高抵抗26、前記電極10と 9、12と11に電圧を供給するための前記電源端子V pp等に電気的接続されている。また、27は電源供給用 10 や信号取り出し用のリードピンである。この構成によ り、例えば、周囲温度に変化が生じた場合には、例えば CO: 用(測定用) 受光電極10 および温度補償用電極 9の温度が変化し、これによる焦電流が前記電極10, 9においてそれぞれ発生するが、前記電極10,9とが 互いに逆極性となるように直列接続されているので、前 記電極10で発生した焦電流と前記電極9で発生した焦 電流の和が零となり、周囲温度の変化に対しても均衡を 保ち、外乱に対しては受光器7として出力することがな い。つまり、周囲温度の変化に影響されない構成になっ 20 ている。

【0021】また、受光器7の上面(受光器7の入射 側)には、上述した2種類(中心波長3.7 µ m と 4. 3μm)の光学フィルタ30,31が設置されている。 つまり、比較用受光電極12の前面にCO, による吸収 のない帯域の波長の赤外光を通過させる光学フィルタ3 0を設けることで、デュアル素子Bは、CO₂の特性吸 収の無い波長3.7μmのみに感度を有する。一方、C O₂ 用(測定用) 受光電極10の前面にCO₂ の特性吸 収帯域の赤外光のみを通過させる光学フィルタ31を設 30 けることで、デュアル素子Aは、CO, の特性吸収帯で ある4. 3 μ m のみに感度を有する。

【0022】一方、前記回路基板4には電気回路が設け られている。すなわち、図8に示すように、光源6に電 流を供給する定電流駆動回路40、受光器7の2つの出 力、すなわち、CO₂ 用 (測定用) 受光電極10のCO 2 出力と比較用受光電極12の比較用出力(図6参照) をそれぞれ増幅し演算する、受光出力の増幅・演算回 路、指示校正回路、電圧安定化回路などで構成されるM CV41が設けられている。更に、CO2 ガスの濃度値 40 を電圧または電流の形で伝送するか、または警報信号を 出力する外部出力回路42が設けられている。また、こ れらの出力をコントロールパネルに伝送する場合には、 送信回路を具備してもよい。なお、43~45は増幅 器、46はマルチプレクサ、47は警報しきい値設定回 路である。要するに、光源6と受光器7は、上述の電気 回路を含めて1つの回路基板4上に形成されており、さ らに回路基板4および楕円反射鏡5は1つの金属ケース 1内に収納・固定されている。しかもフィルタホルダ8 で受光器7を覆っている。したがって、受光器7はフィ 50 位置決めが容易で、保守・点検も容易である。

ルタホルダ8によって光源6からの熱の影響を受け難 く、周囲温度の変化に対しても指示値がより安定すると ともに、外部のノイズに対しても強いCO1 センサが容 易に得られる。

6

【0023】また、図1、図3において、50は、ゴミ や粉塵の流入防止のためのフィルタで、楕円反射鏡5と 回路基板4との間の上部ケース1 a の側面に形成された 開口部2を覆うように配置される。51は、端子台52 を備えた回路基板で、上方には、基板スペーサ53を介 して前記回路基板4が位置する。

【0024】而して、光源6から出射された赤外光のう ち、楕円反射鏡5の反射鏡面 a で反射した反射光束はC O: 用(測定用)受光電極10に集束するとともに、楕 円反射鏡5の反射鏡面bで反射した反射光束は比較用受 光電極12に集束する。

【OO25】つまり、前記出射赤外光が反射鏡面 a でー 回折り返されてCO、用(測定用)受光電極10に至る 折り返し光路Rと、前記出射赤外光が反射鏡面bで一回 折り返されて比較用受光電極12に至る折り返し光路S が別々に形成されるので、集光効率が良く、しかも受光 器7での不要な反射を低減でき、所望の検出感度を得る のに必要な赤外光量を確保できる。

【0026】また、赤外吸収に係る光路の開き角を大き くとれるため、従来と同程度の赤外吸収を1/2の光路 長(吸収長)で得ることができるとともに、小型化を実 現できる。すなわち、光源6から出た赤外光は反射鏡面 a, bでそれぞれ1回折り返すことになり、従来に比べ てそれぞれ2倍の光路長(吸収長)を得ることができ る。また、赤外吸収に係る光路の開き角(光源6の開き 角、受光電極10,12の受光角)を大きくとれるた め、従来構造よりも発光の伝達効率を高くできる。

【0027】このように、赤外吸収に係る光路を折り返 し型にできるため、数 c m~十数 c mのセル長を有する 大型の吸収セルを備えた従来のCO. 計で得ていた赤外 吸収と同程度の赤外吸収を、小型でも十分得ることがで き、受光器7の2つの出力を演算処理することによりC O: ガスの濃度値または警報を出力して空調制御が確実 に行える。なお、この実施形態で採用した比較的低濃度 レンジのCO2 ガスセンサの場合、図6に示したよう に、COL出力と比較用出力が略同等になっている。そ して、CO、濃度が高くなると、比較用出力は減少す る。したがって、CO゛濃度の高い、低いにかかわら ず、CO』出力と比較用出力の差または比を演算するこ とによりCO、濃度に対応した測定値が得られる。

【0028】また、光源6と受光器7を1つの回路基板 4上に設置できるため、回路基板4の構成も簡素化でき る。さらに、従来の構成に比べて、部品点数を減らすこ とができ、ケース1内部の構成を簡素化できる。その 上、組み立てが容易である。更に、集光光学系であるが

7

【0029】更に、前記各素子A, Bごとに効率的に集 光できるので、従来に比して光源の消費電力を低減でき る。

【0030】なお、この実施形態では、光源4をオン・オフする直接変調方式を採用したものを示したが、光源側または受光器側に機械式の光断続器を設けてもよい。

【0031】また、上記実施形態では、凹面反射鏡として楕円反射鏡を用いたものを示したが、同様の機能を有するものであれば放物面を有する反射鏡やその他の球面形状を有する反射鏡を用いてもよい。

【0032】そして、上記実施形態ではCO: ガスセンサを採用したが、他の赤外線吸収を有する被測定ガス(例えば、HC、CO、SO: 等)を測定するガスセンサにもこの発明は適用できる。

[0033]

【発明の効果】以上説明したように、この発明では、光源から出射された赤外光は凹面反射鏡で反射され、その反射光束は感度波長の異なる2つの素子に別々に集束する。つまり、前記出射赤外光が凹面反射鏡で一回折り返されて前記一方の素子に至る折り返し光路と、前記出射 20赤外光が凹面反射鏡で一回折り返されて前記他方の素子に至る折り返し光路が別々に形成されるので、集光効率が良く、しかも受光器での不要な反射を低減でき、所望の検出感度を得るのに必要な赤外光量を確保できる。

【0034】また、赤外吸収に係る光路の開き角を大きくとれるため、各折り返し光路においては、従来と同程度の赤外吸収を1/2の光路長(吸収長)で得ることができるとともに、小型化を実現できる。

【0035】更に、前記各素子ごとに効率的に集光できるので、従来に比して光源の消費電力を低減できる。

【0036】また、光源と受光器を1つの回路基板上に 設置できるため、回路基板の構成も簡素化できる。さら に、従来の構成に比べて、部品点数を減らすことがで き、ケース内部の構成を簡素化できる。しかも光源と受 光器を含む回路基板全体を熱的に安定化させることがで きるので、周囲温度の変化に対しても指示値の変化は少 なく、また、外部のノイズに対しても強く、測定精度、 10 信頼性共に優れたガスセンサを、小型、軽量かつ構成部 品も少なくして得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態を示す全体分解斜視図である。

【図2】上記実施形態を示す全体外観斜視図である。

【図3】上記実施形態を示す全体構成説明図である。

【図4】上記実施形態を示す要部構成説明図である。

【図5】上記実施形態で用いた受光器を示す図である。

【図6】上記実施形態における波形特性図である。

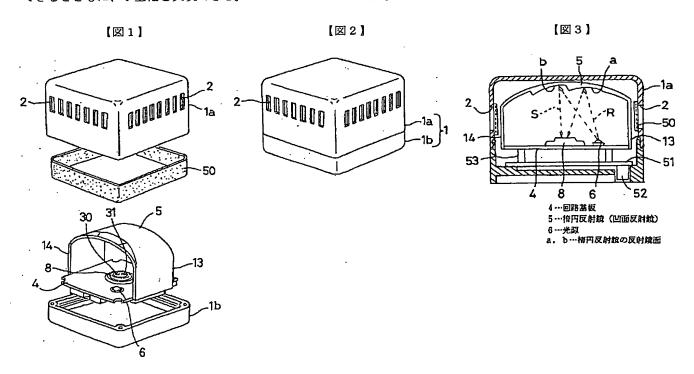
【図7】上記実施形態で用いた受光器の等価回路図である

【図8】上記実施形態における動作説明図である。

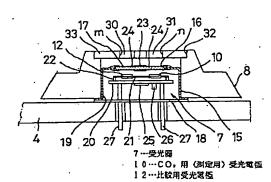
【図9】従来例を示す全体構成説明図である。

【符号の説明】

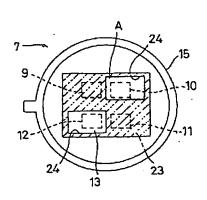
4…回路基板、5…楕円反射鏡(凹面反射鏡)、6…光源、7…受光器、10…CO₂ 用(測定用)受光電極、12…比較用受光電極、a,b…楕円反射鏡の反射鏡面。



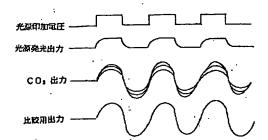
【図4】



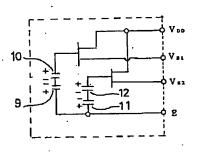
【図5】



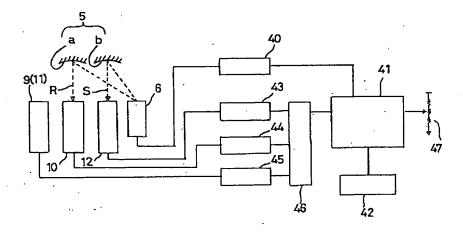
【図6】



【図7】



【図8】



【図9】

